超高速電子写真プロセスにおける液体冷却技術

(採用機種:RICOH Pro C751EX/C651EX)

岡野 覚*, 平澤友康*, 藤谷博充** *株式会社リコー 画像エンジン開発本部 基盤・制御技術開発センター **株式会社リコー PP 事業本部 CS 設計センター

1. はじめに

近年、プロダクションプリンティング、オフィスハ イエンドの電子写真方式におけるコピー/プリンタに おいて発生する熱は、レーザースキャナーや現像ユニ ットでの温度上昇に見られるように、高画質化、高速 化、連続印刷のニーズにともなって、上昇を続けてい る.両面印刷で機内を搬送する紙もまた、大きな熱源 となっている.一方、定着プロセスの省エネルギー化 でトナー軟化点の低下により、温度上昇の許容レベル も下がりつつある.こうした状況にあってもなおコピ ー/プリンタは、ダウンサイジングが求められている.

一般に,発熱体をその周囲から流体で冷却する際, 発熱体の発熱量をW,発熱体表面の熱伝達率をh,発 熱体表面の面積をA,発熱体表面の温度をT_w,周囲の 流体温度をT_aとすると,以下の式が成り立つ¹⁾.

$$W = hA(T_w - T_a). \tag{1}$$

流体温度 T_a は、空冷の場合、空気の温度、すなわち 室温である.ここで、現像ユニットの冷却について考 えてみた場合、その内部には主に摩擦熱の発生によっ て温度上昇したトナーとキャリアがともに対流し、そ れらの温度は至るところでほぼ均一と考えることがで きる.また現像ユニットの場合、発熱体から発熱体表 面までの温度勾配は十分小さいと考えられ、したがっ て、式(1)の $T_w - T_a$ は、発熱体の周囲の流体からの温 度上昇値と概ね考えてよく、今これを ΔT と置き、hに ついてまとめると、以下の式が導かれる.

 $h = \left(W/\Delta T\right)/A.$ (2)

式(2)によれば、Wが上昇し、 AT とAが低下する と、これを満足する冷却を行うには、高い値の h が必 要であることがわかる.現像ユニットの冷却の場合, 必要よりも低い値のhの冷却しか行われないとき,現 像ユニット内部のトナーは許容レベル以上に温度上昇 し、凝集する.このとき、ベタ画像の出力においては 画像面に複数の白スジとなる画像不良を引き起こす. Fig.1 は、当社の中高速機の現像ユニットにおける一 般的な熱の流れを示している. Fig.1 では、トナーの 攪拌の摩擦により発生する熱、

感光体から伝達される 熱、および現像ユニット周囲より伝達される熱の全て が、現像ユニット端部に位置する多数枚のフィンをも つヒートシンクへと輸送され、そこで低温の空気と熱 交換される. Fig.2 は、当社の中高速機の現像ユニッ トのヒートシンクに求められる熱伝達率を示している. 前述の現像ユニットの熱伝達率は、Fig.2 では、A、B グループにプロットされる. 熱伝達率は, 数値の大き さによって冷却方式が大別され、小さい順より、自然 対流(空冷)、強制対流(空冷)、液体冷却等に分け られる.その閾値については必ずしも明確ではないが、 半導体に適用されるガイドに従えば,前記のA,Bグル ープは,空冷の域に位置している²⁾. これらのグルー プの現像ユニットは、冷却方式を空冷とした場合の気 流シミュレーションと実験によって、現像ユニット内 部のトナー温度が許容レベル以下になることが確認さ れ,実際に空冷が選択されている.

しかしながら、発熱量がいっそう増加し、温度上昇の許容レベルと放熱面積がさらに低下すると、これまで以上の高い熱伝達率の冷却が求められる. Fig.2 における C グループは、当社の RICOH Pro C751EXの現

像ユニットに求められる熱伝達率であり,空冷よりも 高効率の冷却,具体的には液体冷却等を利用した冷却 が必要であることを示している.中でも液体冷却は高 効率な冷却方法として知られるが,一般に液体温度を 制御するためのチラーといった大掛かりな装置を必要 とするため,これまでオフィスユースには向かなかっ た.そのような中,近年,コンパクトな液体冷却シス テムが,パーソナルコンピュータにおける CPU の冷却, 高速プリンタにおけるサーマルヘッドや LED ヘッドの 冷却に適用されはじめた^{3,4,5)}.それでも,電子写真の 作像プロセス,ことに現像ユニットへの液体冷却の適 用はなく,Fig.2 における C グループのような現像ユ ニットの冷却を満足する小型な液体冷却技術が切望さ れていた.

本稿では,高速電子写真プロセスに向け開発した, 現像ユニットにおける温度上昇を許容レベル以下にお さえる液体冷却技術について紹介する.



Fig. 1 Routes of heat transfer in development unit.



Fig.2 Heat transfer coefficient for various development units.

2. 液体冷却技術

2.1. 現像ユニットにおける液体冷却の概要

Fig.3 に示すように、現像ユニットにおける液体冷 却では、トナーの攪拌の摩擦により発生する熱、感光 体や機内環境といった現像ユニット周囲の熱を、液体 冷却ジャケットを押し当てて冷却する.液体冷却ジャ ケットは、その内部に流路をもち、室温とほぼ同じ温 度の,水を主成分とする液体が循環し,前記の熱を作 像プロセス領域から機外近傍に配置されるラジエータ /ファンへと輸送する.液体冷却では、液体が空気より も高い熱伝達率をもつために、小型な液体冷却ジャケ ットでもその温度上昇を低くおさえながら多量に受熱 することができる.また、液体は空気よりも熱容量が 大きいために,幅広いダクトを必要とせず,狭いパイ プでも十分に熱輸送を可能にする. ただし, 前述のラ ジエータ/ファンは,空冷のダクトと比べてもけっして 小さいものではない.しかしこれらは作像プロセス領 域から離れた空いたスペースに設置することができる ため、大きな制約になることはない. このように液体 冷却は、作像プロセス領域の省スペース化に大きく貢 献するものである.

現像ユニットから機外まで,液体冷却の高い冷却性 能を低損失で実現するには,液体冷却システムの熱設 計,およびデバイスの開発と最適化が不可欠である. 中でも,液体冷却ジャケットと,このジャケットと現 像ユニットとの接触界面の構成が重要になる.次節以 降では、これらの詳しい説明と、これらを用いた液体 冷却システムの評価結果について述べる.



Fig. 3 Schematic diagram of liquid cooling system in development unit.

2.2. 液体冷却ジャケット

現像ユニットにおける液体冷却では、液体冷却ジャ ケットは最も重要なデバイスであり、液漏れがなく、 温度上昇を低くおさえて多量に受熱する性能が求めら れる.

液体冷却ジャケットは、現像ユニットとほぼ同じ、 300mmを越す長い流路をもつ.このため、CPU冷却のも のと比較すると、流路面積はかなり広く、液漏れのリ スクが高くなる.そこで、我々の液体冷却ジャケット は、この液漏れのリスクを回避するため、Fig.4 に示 すように、流路としてシームレスな銅パイプをUの字 に曲げ、これを挟持する2枚のアルミニウムプレート からなる構成とした.



Fig. 4 Photographs of liquid cooling jacket.

また,液体冷却ジャケットは,高い受熱性能を獲得 するため,評価項目として,式(3)とFig.5で定義され る熱抵抗と液体の流れの圧力差を,測定,および熱流 体シミュレーションによって求めている.

$$R = \left(T_1 - T_{OUT}\right) / \left[\rho C_p Q \left(T_{OUT} - T_{IN}\right)\right]. \tag{3}$$

ただし,式(3),およびFig.5の各記号は以下の通り である.

R	:	液体(流出) ⇔ 液体冷却ジャケット	
		底部の熱抵抗	
T_1	:	液体冷却ジャケット底部の温度	
T_{IN}	:	液体の流入温度	
T _{OUT}	:	液体の流出温度	
ρ	:	液体の密度	
C_p	:	液体の比熱	
Q	:	液体の流量	
ΔP	:	液体の圧力差	



Fig.5 Schematic diagram of measuring liquid cooling jacket.

この際,熱抵抗とは,発熱量に対する温度上昇の比 を意味しており,ある発熱量が与えられたときの温度 上昇を知るための重要な指標になっている.圧力差は, その熱抵抗のパラメータの一つである液体の流量を決 定する指標である.また,測定では,液体冷却ジャケ ット底部の温度 T_1 を一定に制御し,液体の流量 Qをパ ラメータとして,液体の流入温度 T_{IN} と流出温度 T_{OUT} , および液体の圧力差 ΔP を測り,式(3)によって熱抵抗 Rを算出している.このとき,式(3)の分母は本来発 熱量とすべきであるが,ここでは液体による吸熱量 $\rho C_p Q(T_{OUT} - T_{IN})$ にて代用している.一方,熱流体シ ミュレーションでは,汎用の非構造格子系熱流体ソフ

第Ⅳ章 注目技術

トにより,液体冷却ジャケット底部の温度 T_i と液体の 流入温度 T_{IN} を温度境界条件とし、また液体の流量 Q を速度境界条件として設定し、流路の液体の流れと温 度分布、および液体冷却ジャケットの温度分布を三次 元で同時に定常計算し、流出温度 T_{our} と液体の圧力差 ΔP を求め、式(3)によって熱抵抗 R を算出している. Fig.6 は、測定とシミュレーションの結果の一例を示 すものである.シミュレーション結果は、実験結果と も良く一致するため、液体冷却デバイスの開発におい ては、シミュレーションの利用が有効であることもわ かった.



Fig.6 Thermal resistance and pressure loss in liquid cooling jacket.

2.3. 現像ユニットと冷却ジャケットの接触界面

液体冷却ジャケットは,現像ユニットに対し繰り返 し装着・分離しても,その高い受熱性能を持続するた めの現像ユニットと液体冷却ジャケット間の接触界面 の構成が必要である.これを実現するため,Fig.7 に 示すように,現像ユニットの接触界面に,熱伝導シー トとポリエチレンテレフタレートフィルム (PET フィ ルム)を配した.熱伝導シートには柔軟性があり,押 し圧に対して変形しやすい.このため,接触界面で生 じていた微小な空気のギャップは埋められ,熱抵抗が 下がって,高い受熱性能が得られる.ただし,熱伝導 シートには粘着性があるため,現像ユニットを分離す る際,いずれかの側に張り付いて剥がれてしまう場合 がある.前述のPET フィルムには,熱伝導シートを被 覆し,その粘着性をおさえ,PET フィルムを接触界面 として,現像ユニットを分離可能にする効果がある. また,熱伝導シートには脆性もあるため,外力に対し ては時として裂ける場合もある.このためPETフィル ムには,熱伝導シートを保護する役割もある.ただし, PETフィルムの熱伝導率はかなり低く,液体冷却の高 い受熱性能を低下させるため,その厚みは十分薄くす る必要がある.液体冷却ジャケットと現像ユニット間 の受熱性能はまた,それらの接触界面の平面粗さにも 依存するため,熱伝導シートとPETフィルムの構成と 同時にこれらも考慮する必要がある.Fig.8 には,受 熱性能として,熱伝導シートの厚さが 0.5mm と 1.0mm のときの平面粗さに対する 2 面間の熱抵抗の実験結果 の例を示す.



Fig. 7 Schematic diagram of contact surface between development unit and liquid cooling jacket.



Fig. 8 Thermal resistance between development unit and liquid cooling jacket.

2.4. 液体冷却システムにおける熱設計

Fig.9は、当社の RICOH Pro C751EX に、液体冷却シ ステムを設置した概略図である.本システムでは、4 つの液体冷却ジャケットが直列に接続され、イエロー、

マゼンタ、シアン、ブラックの現像ユニットの順に液 体を流している.また、本システムは、熱回路網法と 管路網法により熱設計,および最適化を図っている. Fig. 10 は, Fig. 9 におけるシステム全体の熱回路図を 示している. 熱回路網法では, Fig. 10 における熱の流 れを定式化する. その際, 現像ユニットにおける熱抵 抗と発熱量,およびラジエータ/ファンの熱抵抗とポン プの発熱量は、予め個々に測定することにより得てい る. ただし、液体冷却ジャケットとラジエータ/ファン の熱抵抗は、パラメータとして、液体の流量を定める 必要がある. 管路網法によれば, 液体冷却システムー 周にわたる液体冷却ジャケット,パイプ,およびラジ エータといった各デバイスの圧力差の総和を計算し, この全圧力差から,送液性能として圧力と流量の関係 が既知のポンプをいろいろと選定することにより、液 体の流量を定めることができる. したがって, 前述の 熱の流れの式を解くことにより、Fig.9の現像ユニッ トにおけるトナー,現像ユニットのケース,液体,お よび液体冷却ジャケットの温度上昇値を得ることがで きる.

2.5. 温度上昇の実験結果と予測誤差

Fig.9 に示す液体冷却システムにおいて、ブラック の現像ユニット内部のブラックトナーにおける温度上 昇の測定値と許容レベルとの差を Table 1 に示す.ブ ラックトナーの温度上昇を評価するのは、4 色の現像 ユニットの中で, ブラックの現像ユニットが最も高い 温度の液体が流れ、したがって4色のトナーの中でブ ラックトナーが最も高い温度となり得るためである. Table 1 で見られる温度差は、トナー凝集を回避する のに十分大きく、余裕があることがわかる. Table 1 にはまた, ブラックトナー, およびポンプにおける液 体の温度上昇の測定値とシミュレーションとの差も示 している. ポンプにおける液体の温度上昇を見る理由 は、液体冷却システムを流れる液体の中で、最も高い 温度上昇を示すためである. Table 1 に見られるこれ らのシミュレーションによる予測誤差は非常に小さく, 液体冷却システムが目的の機能を十分果たしているこ

とがわかる.







Fig.10 Schematic diagram of thermal network in development unit and liquid cooling system.

Table 1 Experimental results and prediction

611013.				
	温度上昇の実験と	温度上昇の計算		
	許容レベルとの差	と実験との差		
トナー	-2.0[deg]	+0.5[deg]		
液体		+0.6[deg]		

3. まとめ

電子写真作像プロセスにおける現像ユニットを冷却 する液体冷却技術を世界で始めて開発し,その実用性 を確認した.本技術は,現像ユニットにおける温度上 昇をおさえ,トナー固着を回避する.また,液体冷却 システムのための熱設計技術も獲得することができた. その際,熱流体シミュレーションが有効であることも わかった.

参考文献

- Jack Philip Holman : 伝熱工学<上>, ブレイン
 図書, (1996), pp. 11-13.
- 国峰尚樹:電子機器における熱問題, MATERIAL STAGE, VOL. 1, NO. 4, (2001), pp. 7-11
- 3) Yoshihiro Kondo : The First Laptop Personal Computer using a Silent Liquid-cooling System, Thermal Engineering Conference, (2003), pp. 101-104.
- 4) Tatsuhiko Asada, Hiroshi Kobayashi and Hirotoshi Terao : Study of a D2T2 printing for high-speed print, IS&T's NIP20:International Conference on Digital Printing Technologies, (2004), pp. 993-996.
- 5) Wolfgang Schullerus and Klaus Pachonik : Architecture of A High Performance LED Printhead Platform, NIP24 and Digital Fabrication, (2008), pp. 807-810.

禁 無 断 転 載 2011 年度「ビジネス機器関連技術調査報告書」"IV-5"部 発行 2012 年 4 月 一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA) 技術委員会 技術調査小委員会 〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目 25 番 33 号 NP 御成門ビル 電話 03-5472-1101(代表) / FAX 03-5472-2511